

- [22] Singh, J., Semiconductor Optoelectronics Physics and Technology, (McGraw-Hill, Inc., 1995).
- [23] Dekker, A.J., Solid State Physics (Prentice Hall, Inc., 1958).
- [24] Ali, H.M., Mohamed, H.A., Wakkad, M.M. and Hasaneen, M.F., Thin Solid Films, 515.
- [25] Al-Sabayleh, M.A., J. Sci. Med., 20(1) (2008) 17.
- [26] Khodair, Z.T., Ph.D. thesis, University of Baghdad, College of Education-Ibn Al-Haithem (2011).
- [16] Thangaraju, B. and Kaliannan, B., J. Cryst. Res. Technol., 35 (2000) 71.
- [17] Habubi, N.F., Mishjal, K.H. and Ziad, T.K., Journal of College Education, Al-Mustansyriah University, (2002).
- [18] Omar, A.M., Elementary Solid State Physics, (Addison-Wesley Publishing Company, First Printing, 1975).
- [19] Banerjee, A.N., Ghosh, C.K., Das, S. and Chattopadhyay, K.K., Physica, 370 (2005) 264.
- [20] Stenzel, O., The Physics of Thin Film Optical Spectra, (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany Press, 2005).
- [21] Islam, M.R. and Podder, J., Cryst. Res. Technol., 44(3) (2009) 286.

الجدول (3): بعض قيم معامل الانكسار لأغشية ZnO النقية والمشوبة بالنحاس.

معامل الانكسار عند الطول الموجي (380 nm)	الغشاء ونسبة الإشابة
2.639	ZnO
2.376	ZnO:Cu (3%)
2.368	ZnO:Cu (5%)
2.258	ZnO:Cu (7%)
2.189	ZnO:Cu(9%)

الاستنتاجات

- طبيعة الانتقالات الإلكترونية لجميع الأغشية كانت انتقالات الكترونية مباشرة ممسوحة ومباشرة ممنوعة.
- فجوة الطاقة للانتقالات الإلكترونية المباشرة المسموحة والممنوعة تقل بزيادة نسب التشويب لجميع الأغشية المشوبة بالنحاس.
- التشويب بالنحاس أدى إلى تغير موقع قمة منحنى الانعكاسية ومعامل الانكسار باتجاه الطاقات الفوتونية الواطئة مما يدل على زيادة الامتصاصية.
- معامل الخمود يتزايد في حالة الأغشية المشوبة بسبب زيادة معامل الامتصاص.

تم التوصل في هذا البحث إلى الاستنتاجات الآتية:

- إمكانية تحضير أغشية أكسيد الخارصين باستخدام طريقة APCVD ضمن ظروف التحضير الجديدة.
- غشاء أكسيد الخارصين من النوع متعدد التبلور، وقد أدت إضافة الشوائب ضمن النسب العالية إلى إزاحة قليلة في منحنى الطيف نحو القيم العالية لزواوية الحيود.

المراجع

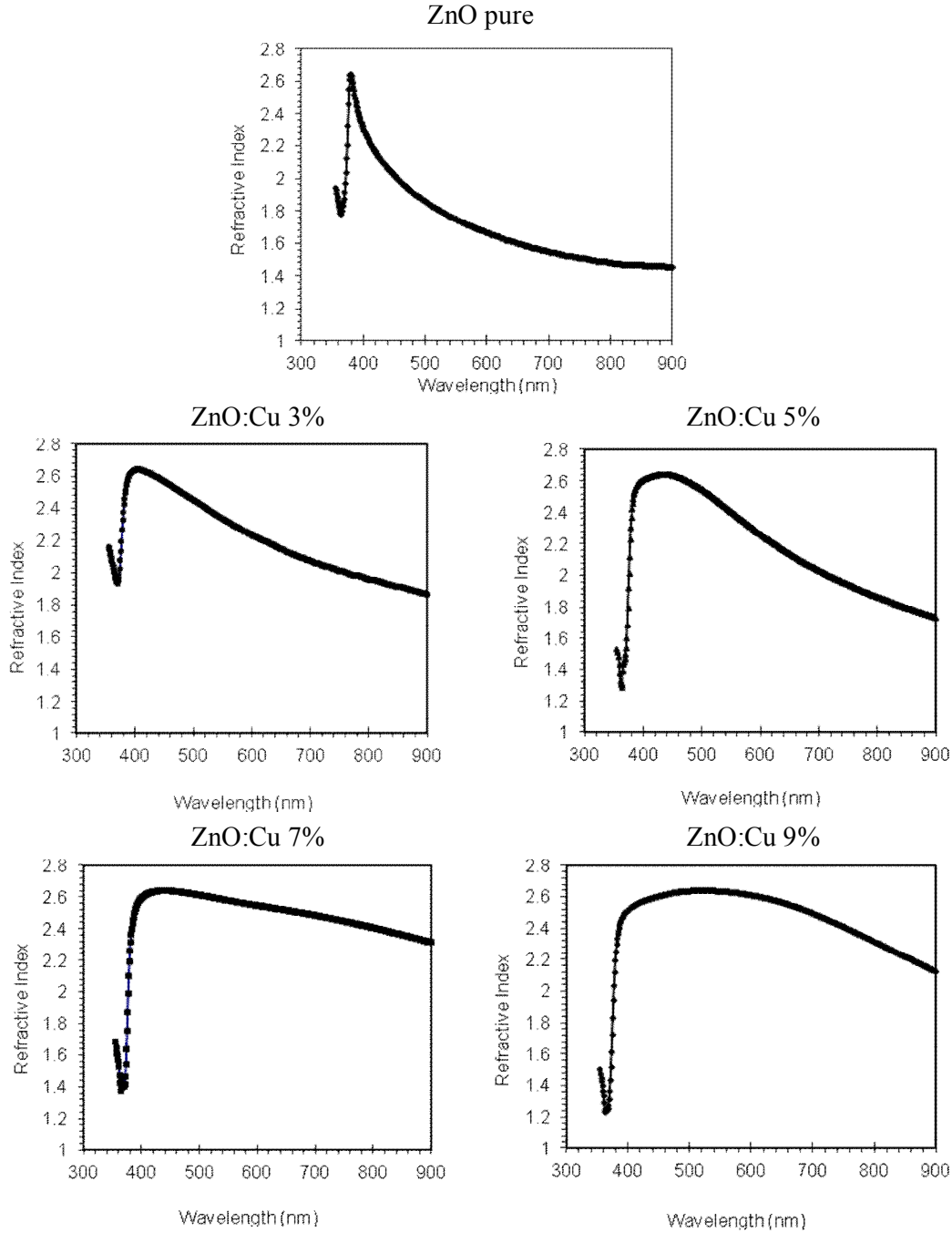
- [1] Adachi, S., Properties of Group -IV,III-V & II-VI Semiconductors, (John Wiley and Sons Ltd., 2005).
- [2] Sharma, R., Shishodia, P.K., Wakahara, A. and Mehra, R.M., Material Science-Poland, 27(1) (2009) 225.
- [3] Shan, F.K., Shin, B.C., Jang, S.W. and Yu, Y.S., Journal of the European Society, 24 (2004) 1015.
- [4] Oztas, M. and Bedir, M., Thin Solid Films, 516 (2008) 1703.
- [5] Yi, G.-C. and Wang, C., Semicond. Sci. Technol., 20 (2005) S22.
- [6] Johnson, S.E. and Owen, J.R., Journal of Physics, 5(11) (1995) 871.
- [7] Kumar, R. and Khare, N., Thin Solid Films, 516 (2008) 1302.
- [8] Jeong, S.H., Park, B.N. and Lee, S.B., J.-H., Surface and Coatings Technology, 193 (2005) 340.
- [9] Ismail, R.A., Al-Naimi, A. and Al-Ani, A.A., e-J. Surf. Sci. Nanotech., 4 (2006) 636.
- [10] Elanchezhiyan, J., Shin, B.C., Lee, W.J., Park, S.H. and Kim, S.C., Cryst. Res. Technol., 44(12) (2009) 1319.
- [11] Xiaming, Z., Huizhen, W., Shuangjiang, W., Yingying, Z., Chunfeng, C., Jianxiao, S., Zijian, Y., Xiaoyang, D. and Shurong, D., Journal of Semiconductors, 30(3) (2009) 1.
- [12] Table of Periodic Properties of the Elements, Sargent-Welch Scientific Company.
- [13] Ilcan, S., Caglar, M., Caglar, Y. and Demirci, B., Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10(10) (2008) 2592.
- [14] Caglar, Y., Zor, M., Caglar, M. and Ilcan, S., Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 8(5) (2006) 1867.
- [15] Caglar, M., Caglar, Y. and Ilcan, S., Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 8(4) (2006) 1410.

طبيعة منحنى معامل الانكسار مشابهة تقريباً لطبيعة منحنى الانعكاسية نظراً لارتباط (R) مع (n_0) وفقاً للعلاقة (5)، وأن أعلى قيمة يصلها معامل الانكسار تكون مقابلة لقيمة فجوة الطاقة تقريباً، أما عند التشويب فنلاحظ أن أعلى قيمة يصلها معامل الانكسار تنحرف نحو الطاقات الفوتونية المنخفضة، والجدول (3) يبين قيمة معامل الانكسار لجميع الأغشية بثبات الطول الموجي.

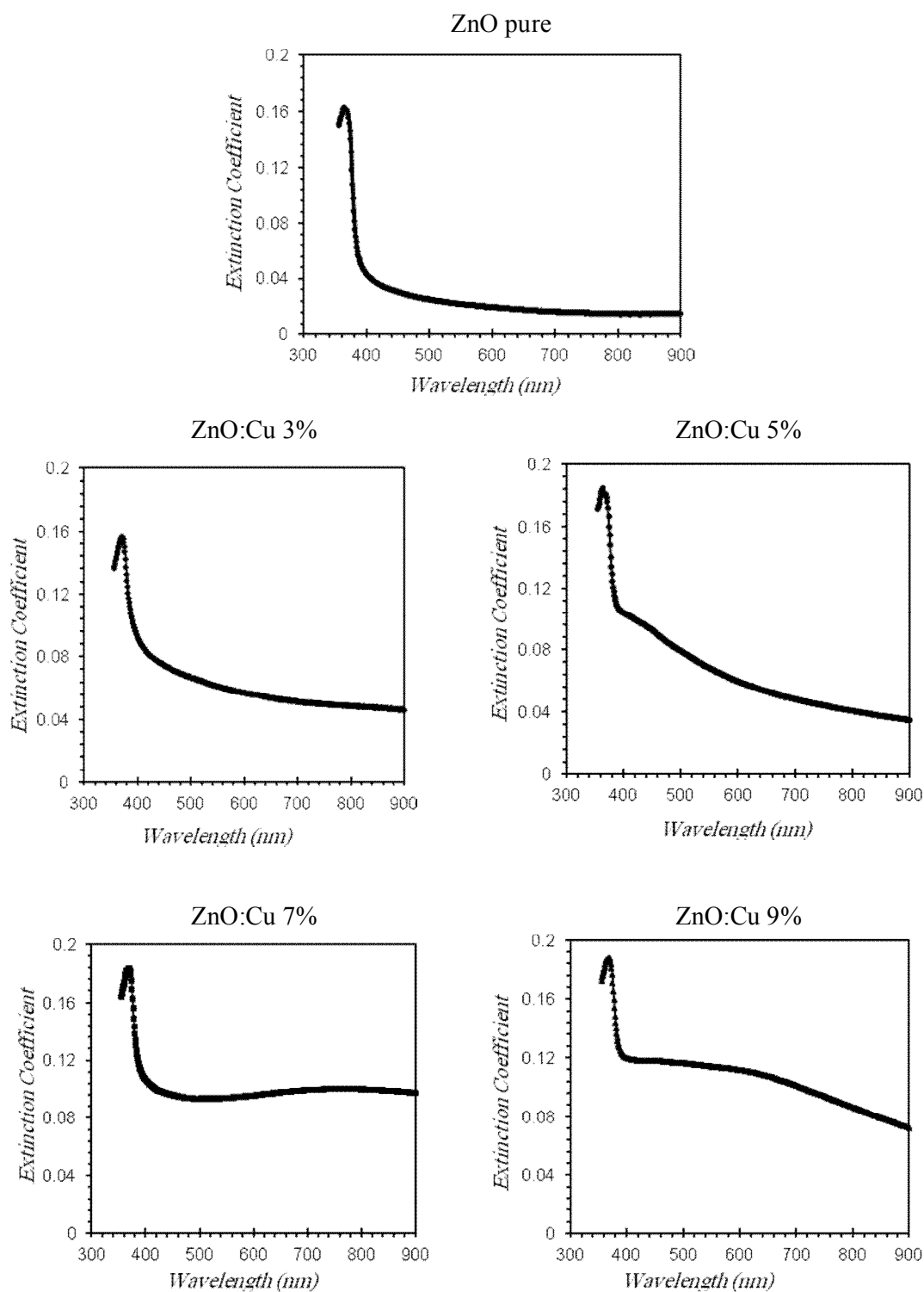
وعند الطاقات المنخفضة تقترب قيمة k_0 من الصفر تقريباً، لذلك يمكن كتابة المعادلة (10) بالصيغة التالية [25]:

$$n_o = \frac{1 + \sqrt{R}}{1 - \sqrt{R}} \quad (11)$$

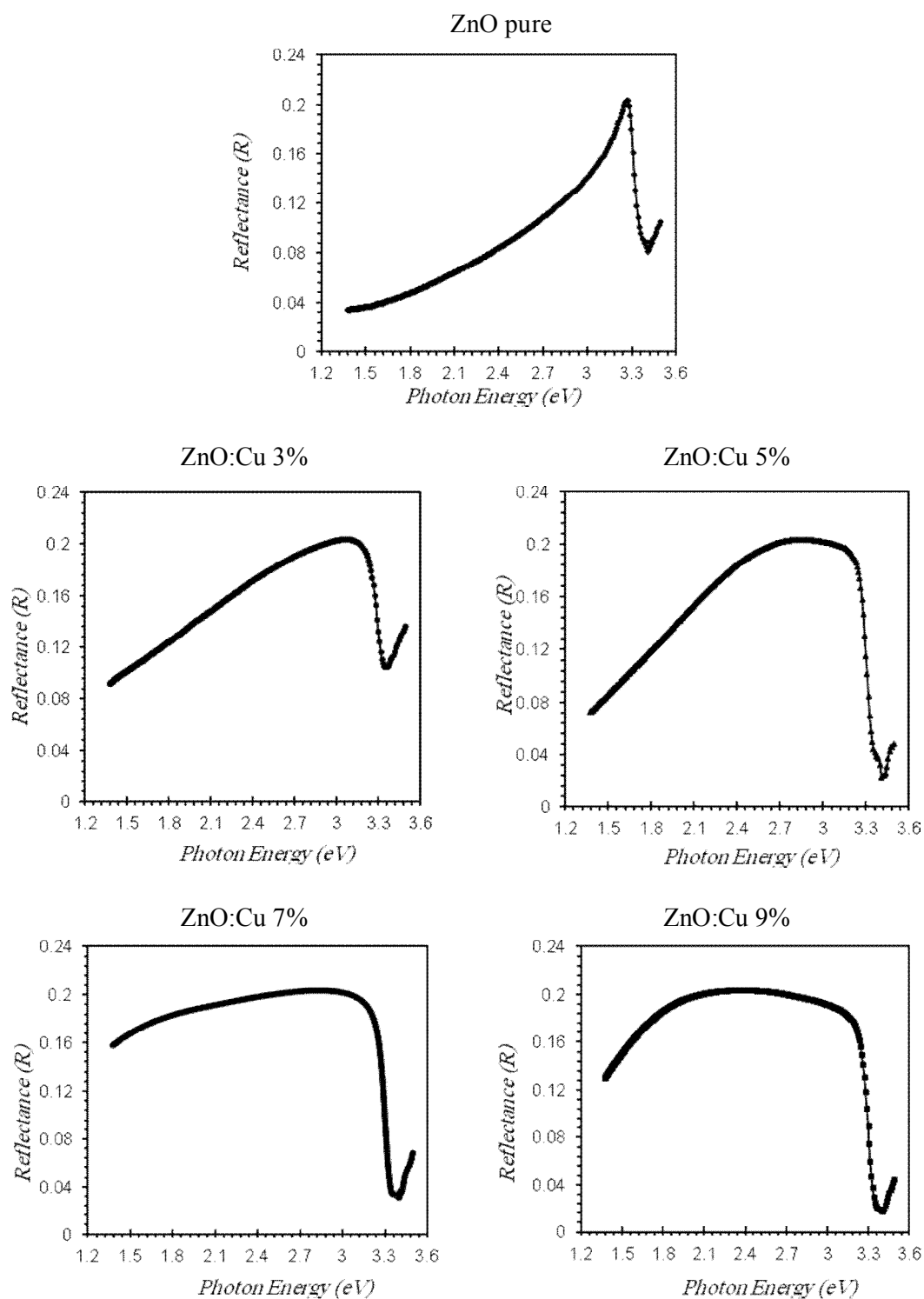
الشكل (9) يمثل تغير معامل الانكسار كدالة للطول الموجي لغشاء أكسيد الخارصين النقي؛ إذ نلاحظ أن



الشكل (9): تغير معامل الانكسار كدالة للطول الموجي لأغشية أكسيد الخارصين النقية والمشوبة ولنسب مختلفة.



الشكل (8): تغيير معامل الخمود كدالة للطول الموجي لأغشية أكسيد الخارصين النقية والمشوبة ولنسب مختلفة.



الشكل (7): تغير الانعكاسية كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الخارصين النقية والمشوبة ونسب مختلفة.

الجدول (2): قيم فجوة الطاقة للانتقالين المباشرين المسموح والممنوع لأغشية أكسيد الخارصين النقية والمشوبة بالنحاس.

الانتقال المباشر الممنوع	الانتقال المباشر المسموح	الغشاء ونسبة الإشابة
$E_g (eV)$	$E_g (eV)$	
3.20	3.25	ZnO
3.12	3.20	ZnO:Cu (3%)
3.10	3.18	ZnO:Cu (5%)
3.08	3.16	ZnO:Cu (7%)
3.03	3.15	ZnO:Cu(9%)

كما يمثل معامل الخمود الجزء الخيالي من معامل الانكسار المعقد (N) بموجب العلاقة الآتية [22,21]

$$N = \frac{C}{V} = n_o - ik_0 \quad (9)$$

إن تمثل:

C : سرعة الضوء في الفراغ.

V : سرعة الضوء خلال الغشاء.

n_o : الجزء الحقيقي من معامل الانكسار (معامل الانكسار).

وفي الحقيقة، فإن معامل الخمود extinction coefficient هو مقدار التوهين الحاصل في شدة الأشعة الكهرومغناطيسية [23]، ومن ثم فهو يمثل مقدار الطاقة الممتصة في الغشاء الرقيق. الشكل (8) يبين تغير معامل الخمود كدالة للطول الموجي لغشاء أكسيد الخارصين النقي؛ إذ نلاحظ أن معامل الخمود يتزايد تدريجياً بتزايد طاقة الفوتون، ثم تعقب ذلك زيادة سريعة عند الطاقات الفوتونية العالية، وهذا يدل على أن هناك زيادة في الامتصاصية أدت بدورها إلى زيادة معامل الامتصاص حسب العلاقة (4) ومن ثم إلى زيادة معامل الخمود. وعند التشويب نلاحظ أن المنحنيات تسلك بصورة عامة السلوك نفسه المشار إليه أعلاه مع انحراف حافة الامتصاص نحو الطاقات الفوتونية المنخفضة، وهذا يؤكد أن حالة التشويب لها تأثير واضح في زيادة المستويات المانحة ومن ثم في زيادة معامل الخمود.

تم حساب معامل الانكسار في حالة السقوط العمودي وفقاً للعلاقة الآتية [24,21,20].

$$n_o = \left[\left(\frac{1+R}{1-R} \right)^2 - (k_o^2 + 1) \right]^{\frac{1}{2}} + \frac{1+R}{1-R} \quad (10)$$

بالاعتماد على طيفي النفاذية transmittance والامتصاصية absorbance، تم حساب الانعكاسية reflectance بموجب قانون حفظ الطاقة من العلاقة الآتية [20]:

$$R + T + A = 1 \quad (7)$$

إن تمثل:

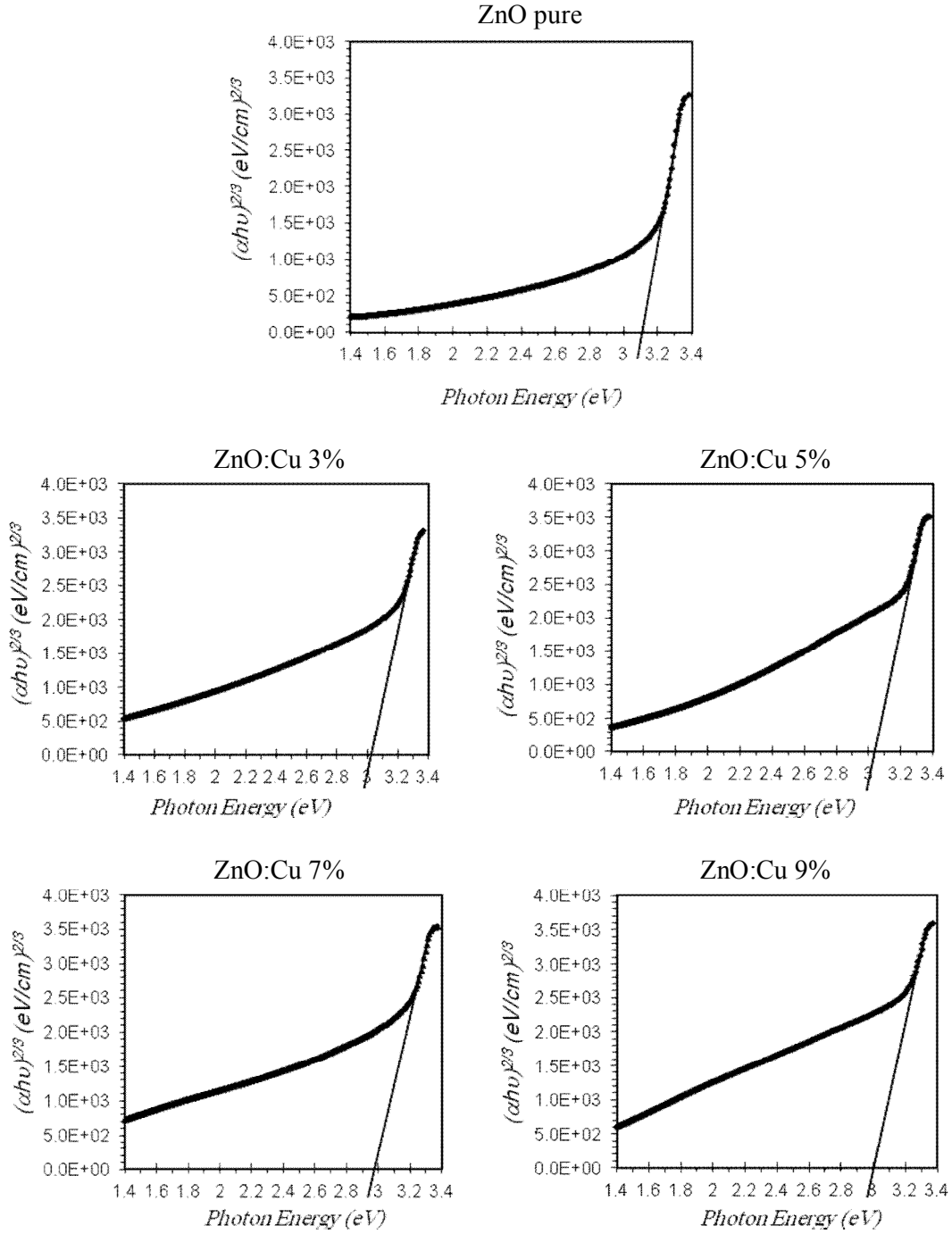
R : انعكاسية الغشاء. T : نفاذية الغشاء.

A : امتصاصية الغشاء.

الشكل (7) يبين تغير الانعكاسية (R) كدالة لطاقة الفوتون ($h\nu$) لغشاء أكسيد الخارصين؛ إذ نلاحظ أن الانعكاسية تكون قليلة عند قيم الطاقات الفوتونية الواطئة ثم تزداد إلى أن تصل إلى قيمة معينة بعدها تبدأ بالانخفاض السريع عند الطاقات الفوتونية العالية. وتفسير ذلك أن الامتصاص يكون قليلاً جداً عند الطاقات الأقل من فجوة الطاقة تقريباً وأن تناقص النفاذية ناتج عن زيادة الانعكاس من سطح الغشاء حسب المعادلة (7)، وعند الطاقات الفوتونية الأعلى من فجوة الطاقة سوف يزداد الامتصاص مما يسبب هبوطاً في الانعكاسية فتتكون عندئذ نروة (قمة) عند الطاقات المقابلة لقيمة فجوة الطاقة، ونلاحظ أن التشويب وللنسب كافة أدى إلى تغير في موقع قمة منحنى الانعكاسية باتجاه الطاقات الفوتونية الواطئة، وهذا بدوره يدل على زيادة الامتصاصية.

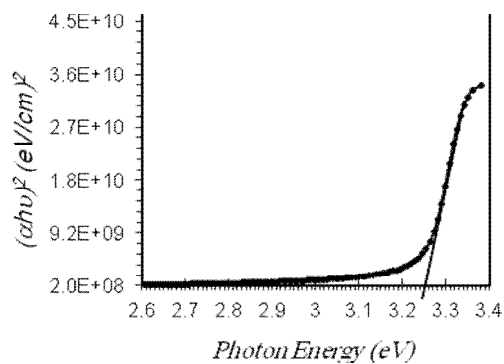
وبالاعتماد على معامل الامتصاص المحسوب من العلاقة (4)، تم حساب معامل الخمود باستخدام العلاقة الآتية [21]:

$$K_0 = \frac{\alpha\lambda}{4\pi} \quad (8)$$

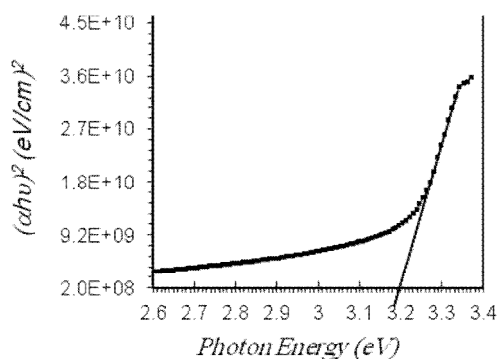


الشكل (6): فجوة الطاقة للانتقال المباشر الممنوع لأغشية أكسيد الخارصين النقية والمشوبة ونسب مختلفة.

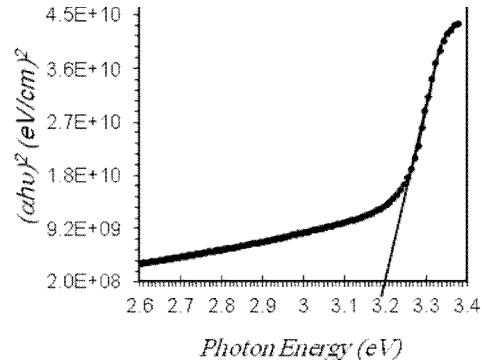
ZnO pure



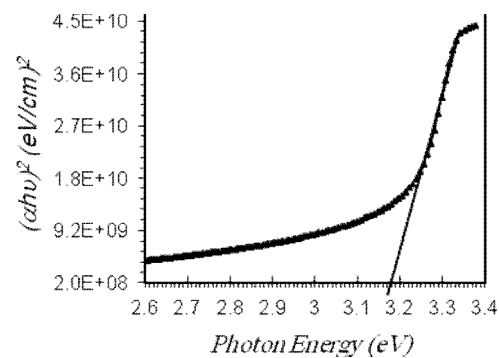
ZnO:Cu 3%



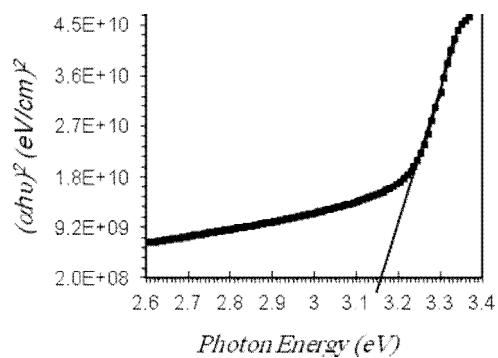
ZnO:Cu 5%



ZnO:Cu 7%

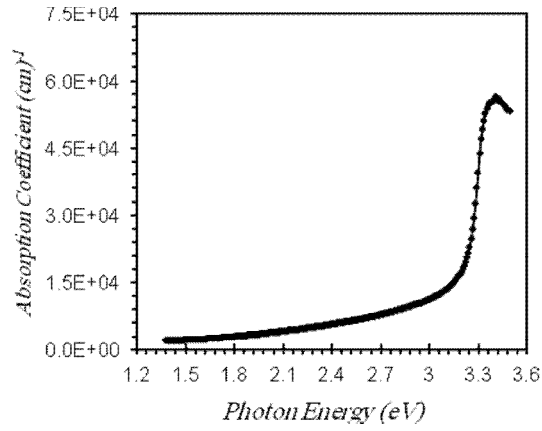


ZnO:Cu 9%

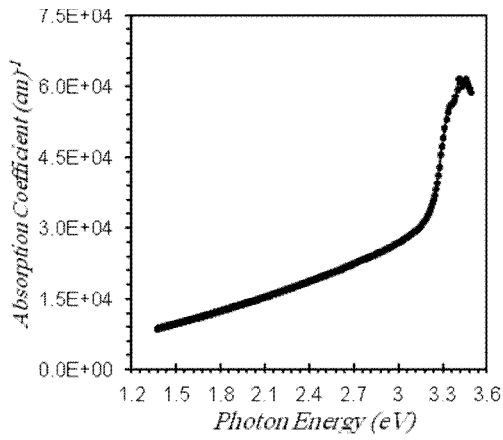


الشكل (5): فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح لأغشية أكسيد الخارصين النقية والمشوبة ونسب مختلفة.

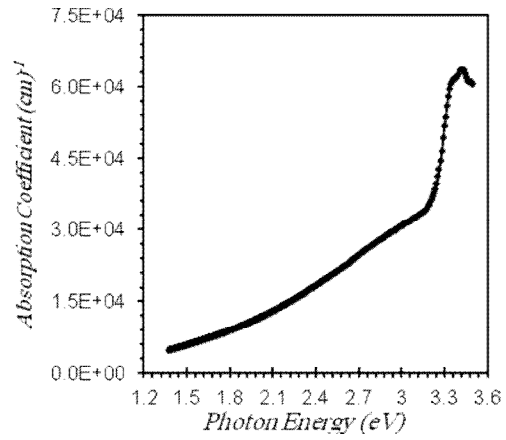
ZnO pure



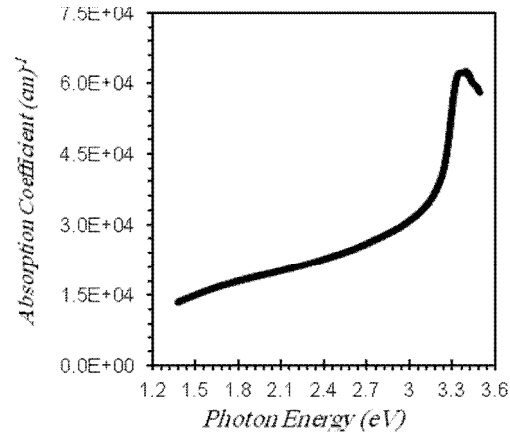
ZnO:Cu 3%



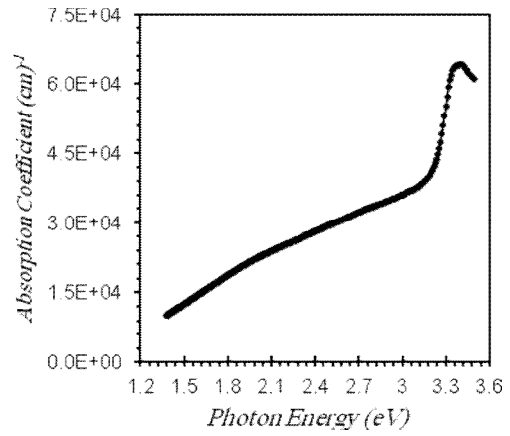
ZnO:Cu 5%



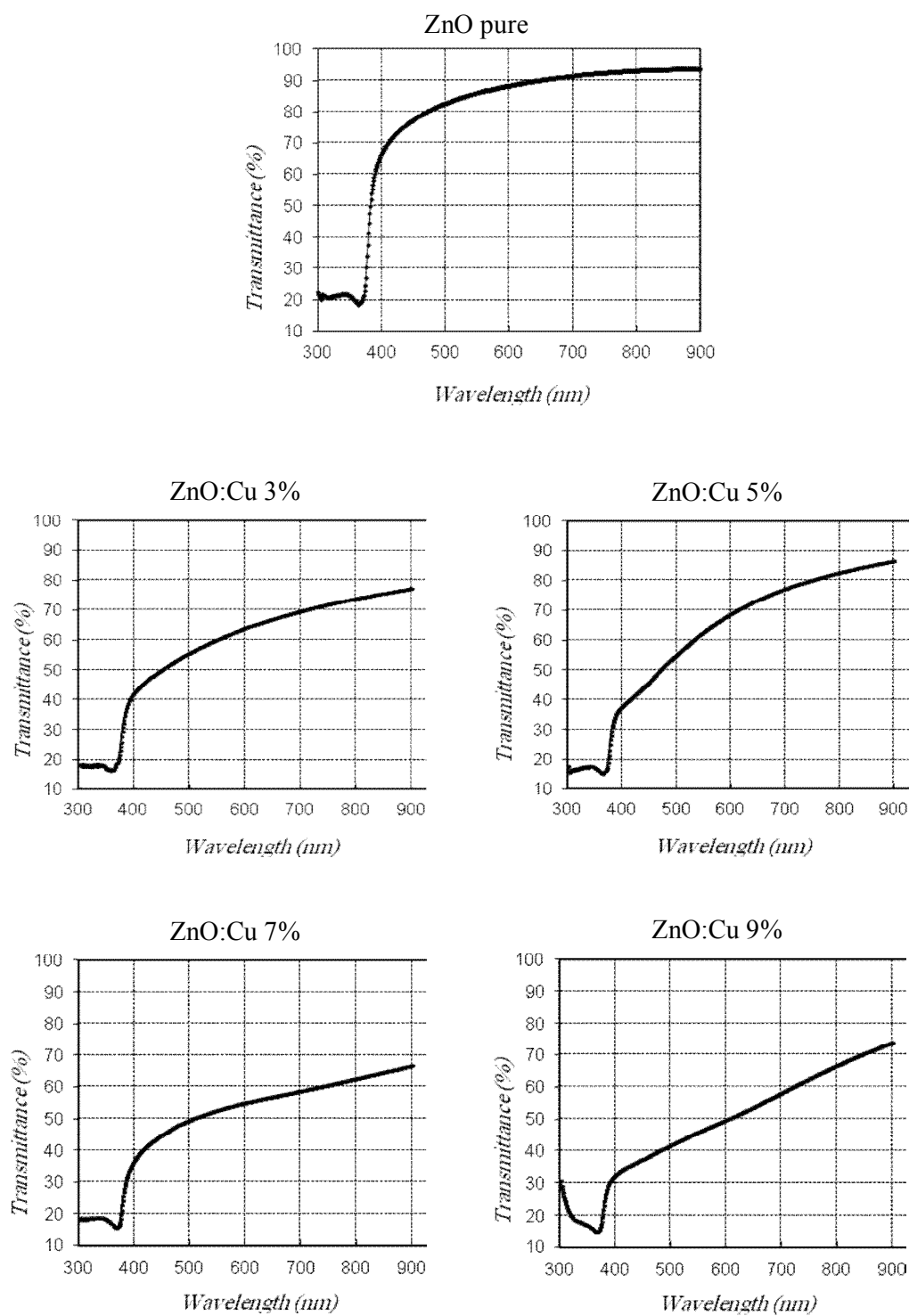
ZnO:Cu 7%



ZnO:Cu 9%



الشكل (4): تغير معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الخارصين النقية والمشوبة ونسب مختلفة.



الشكل (3): تغير طيف النفاذية كدالة للطول الموجي لأغشية أكسيد الخارصين النقية والمشوبة ولنسب مختلفة.

2. الخواص البصرية

بالاعتماد على قيم النفاذية والامتصاصية ضمن مدى الأطوال الموجية (300-900 nm)، رُسمت علاقة النفاذية كدالة للطول الموجي كما في الشكل (3)، وبيّنت هذه النتائج أن أغشية أكسيد الخارصين النقية تمتلك نفاذية عالية معدلها حوالي (90%) في منطقة الطيف المرئي والمنطقة تحت الحمراء القريبة مع نفاذية قليلة في المنطقة فوق البنفسجية تزداد بشكل حاد عند قيم الأطوال الموجية (380 – 400 nm)، وتسمى هذه المنطقة بحافة الامتصاص الأساسية، وهذا يدل على أن المادة هي شبه موصل ذو فجوة طاقة واسعة وأن طاقة الفوتونات في المنطقة عالية النفاذية لا تعاني من امتصاص عالٍ، وكذلك فإن لنوعمة سطح الغشاء وحجم الحبيبات دوراً في تقليل التشبث [15]، ومع زيادة نسب التشويب نلاحظ أن هناك نقصاناً في قيم النفاذية يقابله زيادة في قيم الامتصاصية وانحراف حافة الامتصاص الأساسية نحو الأطوال الموجية الطويلة (الطاقة الواطئة)، وهذا يبين أن التشويب أدى إلى زيادة المستويات المانحة بالقرب من حزمة التوصيل، وبالتالي فإن إمكانية امتصاص الفوتونات ذات الطاقة المنخفضة واردة جداً.

تم حساب معامل الامتصاص في منطقة الامتصاص الأساسية باستخدام العلاقة الآتية [16]:

$$\alpha = -\ln(T) / d \quad (4)$$

إذ تمثل T : نفاذية الغشاء. d : سمك الغشاء.

يوضح الشكل (4) تغير معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لغشاء أكسيد الخارصين والأغشية المشوبة ولمختلف النسب، ومنه نلاحظ أن معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لغشاء أكسيد الخارصين النقي يزداد تدريجياً بمقدار صغير بزيادة طاقة الفوتون ولمدى الطاقات ($h\nu < 3\text{eV}$) ثم تعقب ذلك زيادة سريعة في المدى (3.2-3.5eV)، وهذه الزيادة السريعة تساعدنا على التنبؤ بحافة الامتصاص الأساسية، وقد أظهرت النتائج أن زيادة نسب التشويب أدت إلى زيادة واضحة في جميع قيم معامل الامتصاص، وخاصة عند الطاقات المنخفضة، وهذا يبدو واضحاً من الشكل (4)؛ إذ زحفت حافة الامتصاص الأساسية باتجاه الطاقات الفوتونية المنخفضة.

نلاحظ كذلك أن معامل الامتصاص لجميع الحالات سواء في الأغشية النقية أو المشوبة يمتلك قيمة أكبر من

(10^4 cm^{-1}) في مدى الطاقات العالية مما يدل على حدوث انتقالات إلكترونية مباشرة، وهذا يتفق مع المصدر [17].

تبين من الدراسة الحالية حدوث نوعين من الانتقالات الإلكترونية، وهي الانتقالات الإلكترونية المباشرة المسموحة والممنوعة التي بموجبها أمكن حساب قيمة فجوة الطاقة على النحو الآتي:

أولاً: حساب قيمة فجوة الطاقة البصرية optical band gap في حالة الانتقالات المباشرة المسموحة، أي فجوة الطاقة الواقعة بين قمة حزمة التكافؤ وقعر حزمة التوصيل عند المتجه الموجي ($K = 0$) وباستخدام العلاقة الآتية [18]:

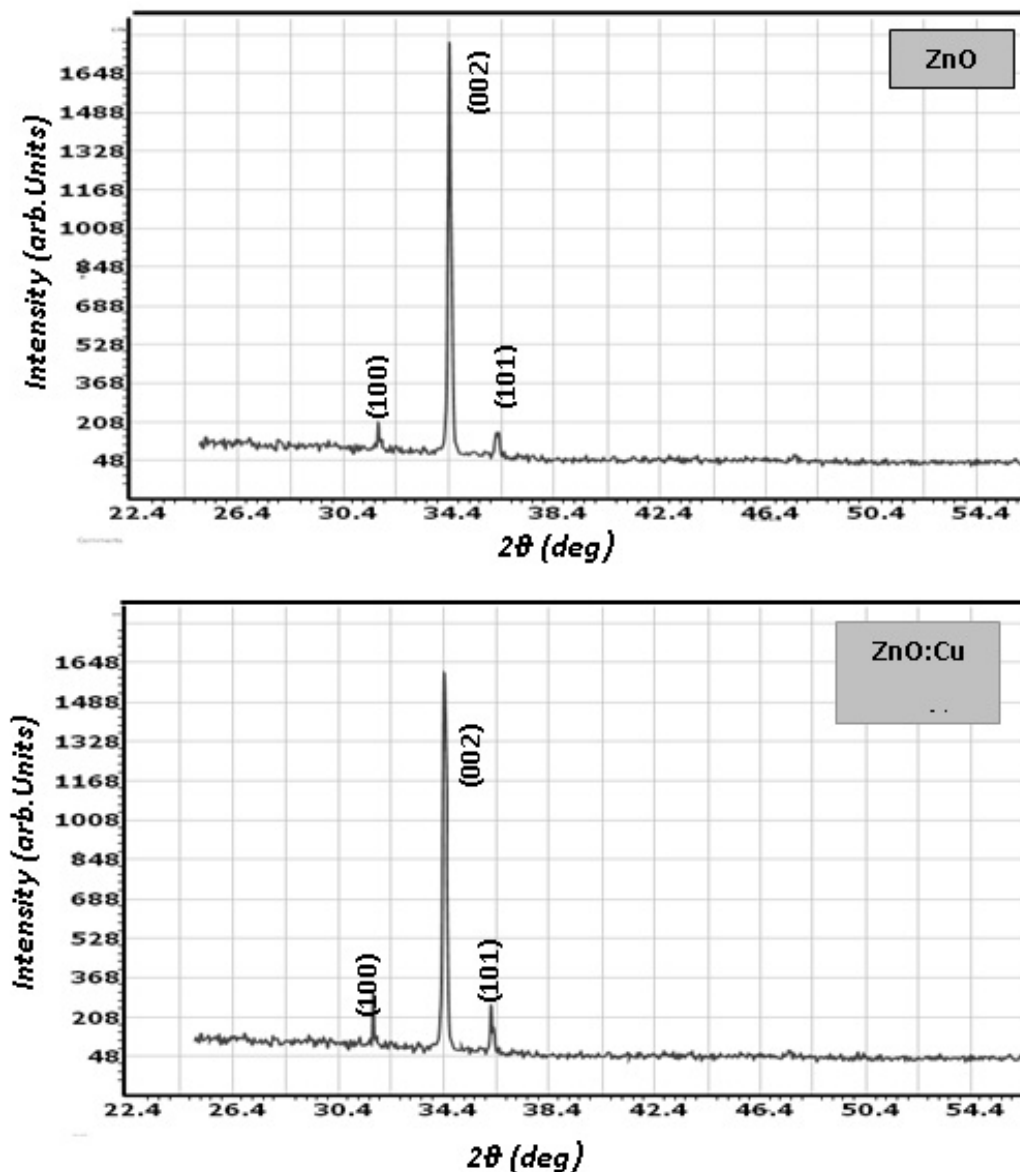
$$(\alpha h\nu)^2 = B^2 (h\nu - E_g) \quad (5)$$

الشكل (5) يمثل المنحني المرسوم بين $(\alpha h\nu)^2$ وطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الخارصين والأغشية المشوبة. وبمد الجزء المستقيم من المنحني ليقطع محور طاقة الفوتون عند النقطة ($(\alpha h\nu)^2 = 0$) نحصل على قيمة فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح، ونلاحظ أن قيم (E_{opt}) تقل بزيادة نسب الشوائب لجميع الأغشية كما هو موضح في الجدول (2)، وهذا يعني أن التشويب أدى إلى إزاحة حافة الامتصاص نحو الطاقات المنخفضة، وهذا النقصان يمكن تفسيره بأن الشوائب أدت إلى تكون مستويات مانحة كما بينا سابقاً داخل فجوة الطاقة وبالقرب من حزمة التوصيل عملت بدورها على إزاحة مستوى فيرمي نحو حزمة التوصيل ومن ثم امتصاص الفوتونات ذات الطاقة الأقل من (3.25eV) حتى (3.15eV).

ثانياً: حساب قيمة فجوة الطاقة في حالة الانتقالات المباشرة الممنوعة باستخدام العلاقة الآتية [19]:

$$(\alpha h\nu)^{2/3} = B^{2/3} (h\nu - E_g) \quad (6)$$

وبرسم العلاقة بين $(\alpha h\nu)^{2/3}$ وطاقة الفوتون ومد الجزء المستقيم من المنحني ليقطع محور طاقة الفوتون عند النقطة ($(\alpha h\nu)^{2/3} = 0$) نحصل على قيمة فجوة الطاقة البصرية لأغشية أكسيد الخارصين النقية والمشوبة. الشكل (6) يمثل المنحني المرسوم بين $(\alpha h\nu)^{2/3}$ وطاقة الفوتون لهذه الأغشية؛ إذ نلاحظ نقصان قيم (E_g) بزيادة نسب التشويب لجميع الأغشية وللسبب السابق نفسه في حالة الانتقالات المباشرة المسموحة، كما في الجدول (2).



الشكل (2): مخطط حيود الأشعة السينية لأغشية أكسيد الزنك النقية والمشوبة بالنحاس.

الجدول (1): نتائج حيود الأشعة السينية لأغشية ZnO النقية والمشوبة بالنحاس.

	Undoped ZnO (002)	ZnO:Cu at 9% (002)	JCPDS for ZnO (002)
2θ	34.452	34.481	34.422
$d(\text{\AA})$	2.6011	2.599	2.6033
d % error	0.084	0.080	—
$a_o(\text{\AA})$	3.2470	3.2440	3.2498
$c_o(\text{\AA})$	5.2022	5.1980	5.2066
Grain size (nm)	60.44	45.96	—

إمكانية أن يحل أيون النحاس محل أيون الخارصين واردة جداً مما يؤدي إلى نقصان حجم البلورة الذي سيؤدي إلى نقصان المسافة بين المستويات البلورية (d) ومن ثم إلى زيادة (2θ) لأن العلاقة بينهما عكسية حسب قانون براغ Bragg's Law ($n\lambda = 2d \sin\theta$), وكذلك يقودنا الاستنتاج الحالي إلى أن ذرات المادة الشائبة ضمن الشبكة الحالية يمكنها أن تتأصّر بسهولة مع الأوكسجين المتوفر بنسبة عالية لتكوّن أوكسيد النحاس الأحادي (CuO) بأكثر الأحوال رغم أننا لم نلاحظ وجود هذا الطور في طيف الحيود، وهذا يعزى إلى نسب التشويب القليلة [9,7]، ويمكن أن يظهر هذا الطور واضحاً عند النسب العالية، كذلك تبين أن هناك زيادة طفيفة في قمم (100)، (101) مما يدل على تحسن التبلور بهذا الاتجاه. الجدول (1) يبين بعض النتائج المحسوبة عن طريق طيف الحيود، وكانت ذات تطابق جيد مع القيم القياسية ضمن نموذج (JCPDS file no. 36-1451)، وقد تم حساب ثوابت الشبكة (a_0) و (c_0) باستخدام العلاقة الآتية [13]:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{4}{3} \left(\frac{h^2 + hk + k^2}{a_0^2} \right) + \frac{l^2}{c_0^2} \quad (1)$$

إن: (h, k, l) تمثل معاملات ميلر Miller indices. وكذلك تم حساب معدل الحجم الحبيبي من علاقة شيرر Scherer [7, 13]:

$$D_{av} = \frac{0.9\lambda}{B \cos\theta} \quad (2)$$

إن:

λ : الطول الموجي المستخدم في جهاز الأشعة السينية.

B : قيمة FWHM.

تم حساب نسبة الخطأ المئوية باستخدام العلاقة التالية [14]:

$$\text{Relative percentage error} = \frac{|Z_H - Z|}{Z} \times 100 \quad (3)$$

إن:

Z_H : قيمة d المحسوبة من الطيف.

Z : قيمة d ضمن بطاقة JCPDS.

أما في حالة التطعيم بالنحاس، فقد استخدمنا المعادلة:

$$t = \frac{m_2 - m_1}{A \cdot \rho_{total}}$$

إن $\rho_{total} = \text{كثافة ZnO} \times \text{نسبته في المركب} + \text{كثافة Cu} \times \text{نسبته في المركب}$.

القياسات البصرية والتركيبية

اشتملت القياسات البصرية على طيفي الامتصاصية (Absorbance) والنفاذية (Transmittance) لمدى الأطوال الموجية (300-900nm)، وذلك باستخدام جهاز من نوع (UV-1650PC) ذي الحزمتين المجهز من شركة (SHIMADZU)، وهو جهاز ذو دقة عالية (0.1 nm)، أما القياسات التركيبية فقد أجريت باستخدام جهاز من نوع (SHIMADZU) أيضاً ذي هدف من نوع (Cu α) وبطول موجي (1.5406 Å).

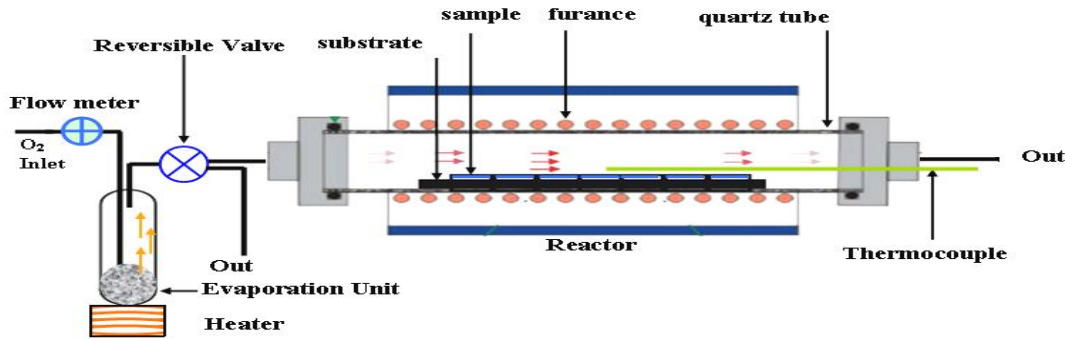
النتائج والمناقشة

1. الخواص التركيبية

إن لتأثير الشائبة داخل البنية البلورية الدور الكبير في تغيير أكثر الخصائص الفيزيائية لأنها يمكن أن تؤثر في أبسط الحالات على حجم البلورة وبالتالي في المسافة بين السطوح البلورية، مما يتسبب بدوره بإزاحة مواقع القمم في محور زاوية الحيود (2θ) ضمن منحني حيود الأشعة السينية إلى قيم أكبر أو أقل اعتماداً على القطر الأيوني لذرات المادة الشائبة عند مقارنتها مع المادة المضيفة (Host) في الشبكة [8]، ومن المعروف أيضاً أن التأثير الفعال للتشويب يحصل عندما تكون ذرات المادة الشائبة أصغر من أو مساوية للقطر الأيوني للمادة المضيفة [9]. في بحثنا الحالي أظهرت النتائج أن أغشية أوكسيد الخارصين النقية والمشوبة بالنسبة (9%) ذات تركيب متعدد التبلور (Polycrystalline) من النوع السداسي (Hexagonal) ضمن الاتجاهية (100)، (002)، (101)، مع نمو متميز بالاتجاهية (002) وهذا يتفق مع البحوث [11,10]، ونلاحظ أن زاوية الحيود ازدادت مع زيادة التشويب، وسبب ذلك أن القطر الأيوني للنحاس أصغر من القطر الأيوني للخارصين [12] وهما ($Zn^{+2} = 0.74 \text{ Å}$) و ($Cu^{+2} = 0.69 \text{ Å}$) كما في الشكل (2)، وبذلك فإن

الجانب العملي

لأجل الحصول على المادة الأساسية في تحضير أغشية أكسيد الخارصين النقية تم استخدام مادة خلاص الخارصين المائية ($\text{Zn}[\text{CH}_3\text{COO}]_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) بعد إضافة الماء المقطر إليها وبالتالي الحصول على محلول مائي ذي تركيز (1M)، وبإضافة نسب وزنية (3-9 %) من مادة نترات النحاس المائية ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) تم الحصول على المحلول المائي الخاص بتحضير الأغشية المشوبة وبنفس التركيز المولاري أعلاه، وبعد إعداد المحلول ترك لفترة زمنية مناسبة للتأكد من عدم وجود أية رواسب ومن ثم وضع في الوحدة الخاصة بالتبخير في منظومة (APCVD)؛ إذ إن وجود مادة التبخر كسائل (Liquid) هي طريقة متداولة في كثير من البحوث المنشورة [6,7]. فبعد أن يصل المحلول إلى مرحلة الغليان يبدأ بخار الماء بالتصاعد حيث يُطرح خارجاً عبر صمام مُعد لهذا الغرض كما في الشكل (1)، ومن ثم يُفتح الصمام الخاص بإيصال المادة المتبخرة إلى حجرة الترسيب.



الشكل (1): مخطط توضيحي لمنظومة APCVD.

إن الأغشية التي تم الحصول عليها كانت شديدة الالتصاق بالقاعدة، ذات تجانس جيد وخالية من التشققات وذات سماكات مختلفة تعتمد على موقع النموذج داخل حجرة الترسيب، وفي بحثنا الحالي كان سمك الغشاء المستخدم ($3000 \text{ \AA}$). فقد تم إيجاده باستخدام الطريقة الوزنية حسب المعادلة:

$$t = \frac{m_2 - m_1}{A \cdot \rho_{\text{zno}}}$$

إذ إن $(m_2 - m_1)$ يمثل الفرق بين وزن الأرصيات قبل ترسيب الغشاء وبعده؛

ρ_{zno} كثافة المادة؛ و t سمك الغشاء.

السنين الأخيرة أمكن تحضير أغشية أكسيد الخارصين كقضبان متناهية الصغر (Nanorods) ذات تطبيقات حديثة [5,26]. يمكن تحضير أغشية أكسيد الخارصين بعدة طرق منها طريقة الترسيب البخاري الكيميائي (CVD)، وطريقة التحلل الكيميائي الحراري (Chemical Spray Pyrolysis)، والتبخير الحراري (Thermal Evaporation)، والترذيد (Sputtering) وغيرها [2]. إن الأغشية التي يتم الحصول عليها بطريقة (APCVD) تكون ملائمة للدراسات العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وتعد هذه الطريقة من الطرائق الاقتصادية ومن أمثلها للحصول على أغشية المركبات العضوية.

يهدف البحث الحالي إلى دراسة خواص أكسيد الخارصين البصرية والتركيبية، ومعرفة تأثير التشويب بالنحاس بنسب (3-9 wt%) على هذه الخواص، وذلك سعياً للحصول على غشاء بمواصفات جيدة، وتحسين صفاته الفيزيائية في منطقة الطيف المرئي.

إن عملية الترسيب في منظومة (APCVD) ذات الجدار الساخن (Hot Wall) المصنعة محلياً والحصول على أغشية بمواصفات جيدة تطلبت وجود عدة مراحل، في بدايتها عملية تنظيف العينات الزجاجية ذات الأبعاد ($2 \times 2.5 \text{ cm}$)؛ إذ وضعت في محلول ترائي كلورو إيثيلين (TCE) ضمن جهاز الأمواج فوق الصوتية ولفترة (10 دقائق)، ثم محلول الأسيتون، وبعدها محلول الميثانول للفترة الزمنية نفسها بعد ذلك تم غسلها بالماء اللأبيوني وتجفيفها بواسطة الهواء الحار. أما ظروف الترسيب فهي على النحو الآتي:

1. درجة حرارة القاعدة 500°C .

2. معدل تدفق الهواء 1.5 L/min .

3. زمن الترسيب 20 min .

المجلة الأردنية للفيزياء

ARTICLE

دراسة الخواص التركيبية والبصرية لأغشية (ZnO:Cu) المحضرة بطريقة APCVD

ميخائيل عيسى منصور

قسم الفيزياء، كلية التربية، جامعة الموصل، الموصل، العراق.

Received on: 11/10/2011;

Accepted on: 22/4/2012

الملخص: في هذه الدراسة تم تحضير أغشية ZnO النقية والمطعمة بالنحاس بنسبة (3-9 %) باستخدام تقنية الترسيب البخاري الكيميائي عند الضغط الجوي الاعتيادي (APCVD) وعلى قواعد من الزجاج بدرجة حرارة أساس (500°C)، تمت دراسة الخواص التركيبية والبصرية لهذه الأغشية. بينت نتائج التشخيص أن هذه الأغشية متعددة التبلور وذات تركيب سداسي مع اتجاه تفضيلي عند (002)، وتضمنت دراسة الخواص البصرية (طيف النفاذية، فجوة الطاقة، معامل الامتصاص، الانعكاسية، معامل الانكسار، معامل الخمود)، ووجد أن قيم فجوة الطاقة تتناقص من 3.25 – 3.15 eV، وأن معدل النفاذية (90 %) ضمن منطقة الطيف المرئي.

Studying the Structural and Optical Properties of ZnO:Cu Prepared by APCVD Technique

Mekhaiel Manssor

Physics Department, College of Education, Mosul University, Iraq.

Abstract: Undoped and Cu-doped ZnO at (3-9 wt. %) thin films have been prepared by APCVD technique on glass substrates at 500°C. The structural and optical properties of these films were studied. The results of the structural tests showed that these films are of a polycrystalline hexagonal structure with a preferred orientation in the (002) direction, the optical properties included transmittance, energy gap, absorption coefficient, reflectance, refractive index and extinction coefficient, the energy gap values were found to decrease from (3.25 to 3.15 eV) and the average transmittance was found about (90%) in the visible region.

Keywords: TCO; ZnO; APCVD; Optical properties.**PACS:** 60:70

المقدمة

أوكسيد الخارصين أحد مركبات الخارصين الكيميائية، ذو تركيب بلوري سداسي (Hexagonal) من نوع (Wurtzite)، ويعد أحد أشباه الموصلات واسعة الاستخدام لكونه يمتاز بفجوة طاقة مباشرة (3.37eV) عند درجة حرارة الغرفة وطاقة ربط عالية للإكسيتون (Exciton) قيمتها (60meV)، ينتمي إلى المجاميع (II-VI) في الجدول الدوري ومن النوع السالب (n-type)، ذو توصيلية عالية ناتجة من وجود فراغات الأوكسجين

وبذلك فهو مشابه في خواصه البصرية إلى حد كبير لمادة GaN [1-3]. ونظراً لنفاذيته العالية (High Transparency) في المنطقة المرئية والمنطقة تحت الحمراء القريبة فقد صُنّف ضمن أكاسيد التوصيل الشفافة (Transparent Conducting Oxides) ذات التطبيقات الواسعة في النبائط الكهرو بصرية، مثل الخلايا الشمسية، وشاشات العرض السائلة، والمتحسسات الغازية والكيميائية، ودايودات الانبعاث الضوئي [4]، وفي